

專利分析

(一)何謂專利分析

研發人員透過專利檢索獲得相關專利列表後，若僅針對專利內容進行逐篇閱讀，顯然未將專利文獻的應用最有效化。如果能將檢索結果所得專利進一步利用統計分析產出各式圖表加以運用，除可提供研發人員瞭解技術發展趨勢，更可提供管理階層作為產品開發策略擬定之重要參考。綜而言之專利分析主要係針對特定之技術特徵或技術主題，採取系統化之方法進行專利檢索後之彙整、分析，最後產出具有關聯性資訊圖表者稱之。專利分析係將繁雜的專利文獻有系統地加以整理，並透過統計分析之方法製作便於閱讀與分析之圖表。

(二)專利分析之應用時機

以下分別自研發所處階段來瞭解專利分析之應用時機。

1.研發前期階段

若企業正值研發前期，此時要面對的是產業內已存在的競爭者，以及這些競爭者所布局之主要專

2 智慧財產培訓學院教材

利；此外企業內部研發部門正經歷概念激盪期，此時最必要的工作在於如何落實概念與構想，確認其是否可行與具有一定之進步程度，因此企業於本階段應分析這些專利技術的內容與分布，找尋適當的切入點以確立研發方向。

2.研發階段

當企業進入研發階段，著手進行技術研發工作，此時主要目的為監測產業內各公司取得相關專利的變化趨勢，因為若遭遇競爭對手研發相似技術，將會提高專利申請案被核駁機率。因此處於本階段的企業主要專利分析工作為專利監控，尤其應包含早期公開專利文獻之分析，透過定期對特定技術領域進行最新專利分析，瞭解最新專利文獻及競爭對手的專利布局。

3.商品化階段

待企業完成技術研發後並開始著手商品化，此時企業要面對的問題是如何將研發成功的技術轉為具體商品並推入市場，一件具有領先技術的專利不一定能夠成功商品化，必須搭配市場概況、相關制度與措施等關鍵影響因素的妥善規劃，縝密而詳細的規劃可提升技術商品化的成功機率，因此位於此

階段的企業除持續監控競爭對手布局之外，更應加強對產業現況、資產評估，與相關金融法令與租稅制度配合分析。

4. 授權／移轉／技術聯盟階段

在授權／移轉／技術聯盟階段，不管是企業欲將自有專利授權／移轉出去，或是欲取得他人專利的授權／移轉，抑或欲與相關技術夥伴組成技術聯盟等，均需事先確認相關專利於整體技術布局中的角色定位。因此相關專利分析之應用，主要以技術關聯分析與技術功效分析為主，加上智慧資產評估，以瞭解企業擁有智慧資產之真正價值。透過技術關聯或技術功效分析，則可清楚掌握整體產業技術布局現況，以及公司自有專利所在落點，藉此可以得知公司自有專利的潛在授權／移轉對象，以及公司所需技術之可能專利授權來源，並且在欲成立技術聯盟時，更能清楚掌控潛在的聯盟成員；而藉由智慧資產的評估，企業就能以更合理且更有效率之方式計算其資產價值。

(三) 專利分析的流程

完成專利檢索後進入專利分析階段，專利分析流程

中部分工作項目可同步進行整理如圖1，首先建立技術領域分類法則，針對重要專利精讀剖析後可進行申請專利範圍分析，而閱讀重要專利並將其歸入技術領域分類的同時，可應用專利指標進行國家／機構／領域競爭力分析及特定技術研發力分析。

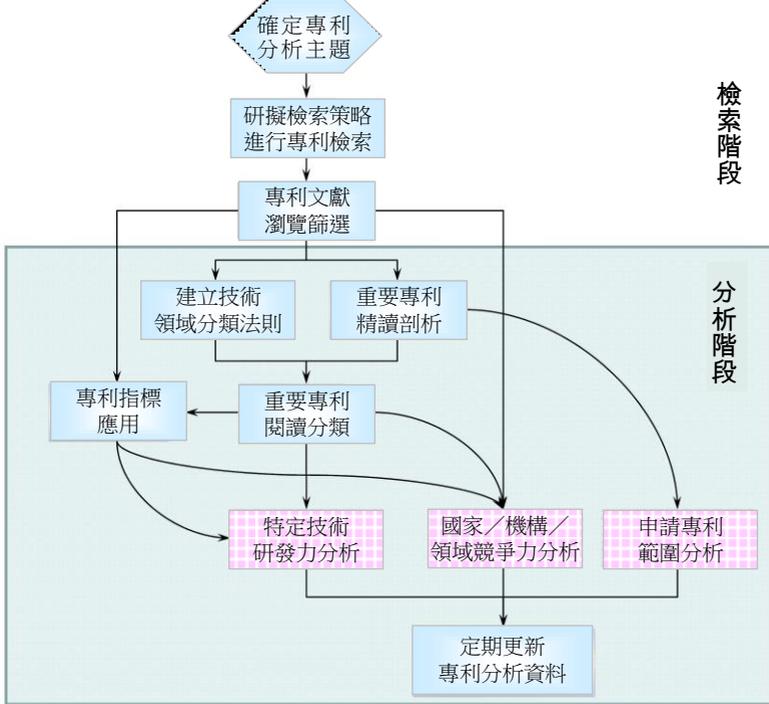


圖1 專利分析階段

1. 建立技術領域分類法則

完成專利檢索及專利文獻瀏覽篩選後，為進行特定技術研發力分析，需要建立技術領域分類法則，從主觀技術領域的角度來觀察技術研發力。在此所指之技術領域分類法則並非現有之專利分類（IPC、USPC、FI/F-term……等），而是專利分析者依需求主觀建立的分類法則，一般多分為技術、功效……等不同構面，每一構面亦可細分階層成為樹狀結構的分類，此一技術領域分類法則建立後，亦可於後續「重要專利閱讀分類」階段依實際專利現況彈性調整。因此相同分析主題、相同專利文獻由不同分析者所建立的分類法則將有所不同。

2.重要專利精讀剖析

在建立技術領域分類法則的同時，可對篩選後的專利文獻再次挑選重要專利進行剖析，並填寫專利閱讀分析表以達到知識分享與管理之目的，而重要專利精讀剖析結果亦可根據技術分類法則予以分類，以進行特定技術研發力分析，或是依需求進行更詳細的申請專利範圍分析。

3.重要專利閱讀分類

完成重要專利精讀剖析後，如要進一步進行特定技術競爭力分析，則有必要將重要專利根據技術

領域分類法則予以分類，每一專利於每個分類構面均應有所屬之分類項。

4. 專利指標應用

應用專利指標以客觀量化方式評量專利表現，亦可作為國家／機構／領域競爭力分析以及特定技術研發力分析的輔助資訊，而專利指標應用的資料源可以從專利文獻瀏覽篩選的結果來分析，也可以從重要專利閱讀分類後的結果來進行。

5. 國家／機構／領域競爭力分析

國家／機構／領域競爭力分析可在完成專利文獻瀏覽篩選後，即進行整體競爭力的客觀趨勢分析，亦可接續在完成重要專利閱讀分類後，針對特定技術領域分類進行客觀趨勢分析。國家／機構／領域競爭力分析是利用統計與指標分析探討國家／機構／領域的整體專利技術趨勢，以及在不同技術領域的表現差異，分析結果代表國家／機構／領域整體專利技術發展的現象與趨勢。

6. 特定技術研發力分析

特定技術研發力分析與國家／機構／領域競爭力分析不同，國家／機構／領域競爭力分析是以客觀、綜觀角度分析國家／機構／領域的整體趨勢，

而特定技術研發力分析則多是針對特定技術主題，以主觀、微觀角度分析個別技術間的差異。由於特定技術研發力分析的製作通常多是針對重要專利文獻來進行，若人力、時間成本允許，針對分析主題內所有專利文獻進行特定技術研發力分析，將可得到更完整之技術間差異比較分析。

7. 申請專利範圍分析

申請專利範圍分析主要鎖定特定專利或產品與可能侵權專利間的專利權範圍解析與比對，作為可專利性評估或侵權比對的依據，因此可在重要專利精讀剖析後進行。

8. 定期更新專利分析資料

由於技術的發展與時俱進，而專利文獻更是年年大幅成長，因此不論是專利檢索或專利分析的結果，僅能代表該檢索／分析時間點所呈現的現象，一段時間後須重新檢討檢索策略的適切性，以及新專利的產生與舊專利的失效等重點。為了維持專利分析的時效性，專利分析者應定期檢討並更新專利分析資料。

(四) 專利分析的種類

1.數量分析

利用檢索出來的專利數量資料，針對總專利數、國家數、專利權人數、發明人數，以及專利分類號等進行數量統計分析，以掌握分析對象之表現或目前發展狀況。

概況分析：藉由統計檢索結果之總專利數、國家數、專利權人數、發明人數、專利分類數等，來掌握檢索結果的概略狀況。

研發力分析：藉由統計國家、專利權人及發明人之專利數，並以專利數量之多寡初步判別各國／專利權人／發明人之研發力。

研發陣容分析：藉由統計各國家擁有之專利權人／發明人數，以及各專利權人擁有之發明人數量之多寡，用以判別該國家／專利權人之研發陣容。

專利分類分析：所謂專利分類分析，即是透過專利分類號，對某一分類號的專利權人、國家或技術進行分析，藉此瞭解目前相關技術領域之密集或空白區域，以找出可發展的潛在技術及研發利基。

2.趨勢分析

趨勢分析係指將相關專利的專利權人及其所屬國家或地區等資料，依時間進行的比較及分析，亦

即透過統計分析不同對象或技術之專利申請件數、核准件數、發明人數、專利權人數、各國專利數、專利分類數等，根據時間軸展開製成適當圖表，以瞭解分析對象或技術之成長率、歷年變化趨勢或發展走向。

歷年概況分析：分年統計專利數、國家數、專利權人數、發明人數、分類號（IPC、USPC）數等，除能掌握檢索結果的概況外，將統計結果繪製成圖表，亦可檢視歷年技術領域之發展趨勢。

歷年研發力分析：分年統計國家、專利權人及發明人之專利數，藉以掌握各國家／專利權人／發明人之歷年研發力消長情形及趨勢。

歷年研發陣容分析：分年統計各國家擁有之專利權人／發明人數，以及各專利權人擁有之發明人數，以歷年專利數之消長情形判斷各國家／專利權人之研發陣容。

歷年專利分類分析：分年統計各專利分類號之專利數，能夠得知歷年技術之分布領域，進而找出歷年技術領域分布之趨勢及轉變。

技術發展趨勢：依據成長模式判斷技術階段，亦即由專利件數的累積窺知某特定技術的發展趨勢，藉此預測其處於萌芽期、發展期、成熟期或是

衰退期。

3. 指標分析

常用之分析指標包括專利被引用次數、優質專利指標、即時影響指標、技術強度、優質技術強度、科學連結指標及技術週期指標等。

專利被引用次數 (Times Cited)：被引用係指某人因各種動機參考他人之專利技術，則被參考之專利可視為對他人之研發具有影響力，因此被引用次數愈高，該專利影響力愈大他人引用，他人引用代表該專利對產業內企業的研發活動影響力較大，而相對來說，相似技術領域的專利受到研發人員較多矚目。專利被引用次數又可區分為自我引用與。

即時影響指數 (Current Impact Index)：衡量特定企業的專利被引用頻率，相對於母體（可以是整個產業專利、整個國家專利、亦或整個專利資料庫）的平均表現，若企業擁有愈多的高被引專利，則被認為有愈強的技術地位。企業的即時影響指數計算，為該企業於前五年中，每年專利在今年度被引用次數除以該年專利數，產出該年度專利的平均被引用率，本比率再除以母體同時期的平均被

引用率，產出該年度的相對平均被引用率，作為該年度專利數的權重，前五年每年專利數乘以該年度權重後，加總的平均數即為今年度的即時影響指數值。

優質專利指數 (Essential Patent Index)：一般認為專利被引用次數愈多，代表其品質可能愈高，在該技術領域愈具有重要地位，然而被引用會受引用者不同而有所不同，同時引用次數易受年代影響，年代愈久的專利累積的被引用次數可能愈多，因此Chen, Lin & Huang (2007) 提出優質專利指數，依據專利被不同引用者的引用情形給予不同的權數，並且在不同年代的被引用次數也給予不同的權數，藉此去除引用者差異及年代影響因素。

技術強度 (Technological Strength, TS)：技術強度象徵專利組合的強度，為專利組合的品質加權，也就是專利數乘以即時影響指數，由專利品質影響專利組合的增加或減少。使用技術強度可發現某一企業擁有較多專利數，但另一家專利品質較佳的企業可能更具有技術影響力，故技術強度為一同時兼顧專利質與量的衡量指標，計算方式如下：

$$TS = \text{即時影響指數(CII)} \times \text{專利數(P)}$$

優質技術強度 (Essential Technological Strength, ETS) : Chen, Lin & Huang (2007) 在提出優質專利指數的同時，亦提出優質技術強度，以合併即時影響指數及優質專利指數來評比專利品質表現，而專利數量表現仍採用專利數來評比。將專利數、即時影響指數及優質專利指數等三者的乘積作為優質技術強度，為一結合專利數量與專利品質概念的衡量指標。優質技術強度的計算方式如下：

$$\text{ETS} = \text{專利數(P)} \times \text{即時影響指數(CII)} \\ \times \text{優質專利指數(EPI)}$$

科學連結 (Science Linkage, SL) : 科學連結象徵企業技術的前端程度 (Forefront, Leading Edge) ，為衡量企業專利引用科學文獻及研究出版品的平均數，可看出企業專利與科學研究間連結的緊密程度。科學連結即每件專利引用科學文獻之平均數，也就是專利引用非專利文獻的情形，可用來瞭解專利與基礎科學之間的關係。科學連結的計算方式如下：

$$\frac{\text{專利引用之非專利文獻總數}}{\text{專利總數}}$$

技術週期指數 (Technology Cycle Times, TCT)：技術週期時間指出技術創新或沒落的速度，為企業專利與引用早先專利的年份差中位數，企業較競爭者擁有較短的週期時間，表示其能更快速從早期技術進展到目前技術。如果技術週期時間較短，代表該個體是基於較新技術為基礎進行技術創新。技術週期時間具產業依存性 (Industry dependent)，即技術週期時間會因技術領域不同而有所差距，熱門技術的技術週期時間較短，如電子類技術週期時間約3至4年，而製藥類平均技術週期時間約為8至9年，造船類技術週期時間可能長達15年。

4. 引用網絡分析

引用網絡分析係利用專利文獻之間引用及被引用之概念，建構出專利的引用關係網絡。以專利權人之角度來看，專利技術網絡分析能夠將具有技術合作或技術研發性質類似之專利權人加以群聚，並掌握特定技術演變趨勢，亦有助於推演專利技術擴散情形。例如圖2為某技術之專利，其中 Progressive System Technologies、NEC Corporation 與Empak Inc.均引用Fluoroware的專利，則此三家

公司可視為技術高度相關之群體，其不論在技術主題、研發方向均十分相似，未來應持續追蹤彼此間研發狀況。

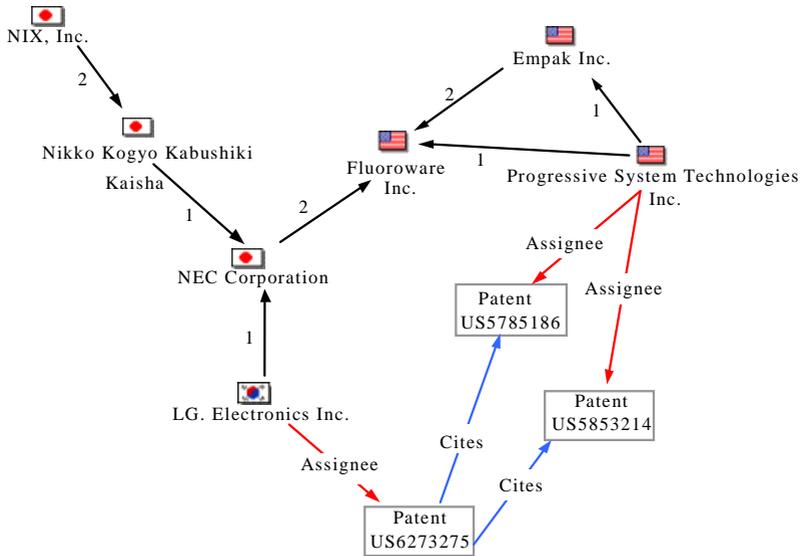


圖2 專利權人引用網絡分析

5.技術功效矩陣分析

技術功效矩陣用來分析某主題的專利主要應用於哪些技術手段，以及其所欲達成之功效。將技術手段與功效的分布狀況繪製成技術功效魚骨圖如圖3所示。其中軸線的終點處為主要欲達成之技術功

效，軸線上各支點為使用之技術手段或功效目的。將相關技術與功效整理為技術功效魚骨圖之後，再分別統計出對應各項技術與功效內專利分布件數，以呈現出特定技術功效的專利數，專利數愈多代表產業內各公司投入較多研發；專利數愈少代表投入較少，範例如圖4所示。透過分析技術功效矩陣表，可以一目了然各種技術手段的分布與功效，並且可由統計表瞭解該領域之各種技術手段與功效，故可作為後續進行技術創新或迴避設計時之資料源，以支援架構專利網或衍生新的專利。

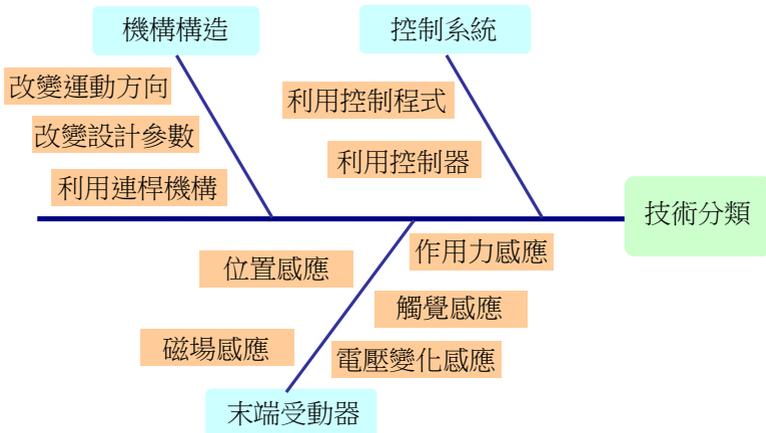


圖3 技術功效魚骨圖

16 智慧財產培訓學院教材

第一階—複合材料加工專利						
技術分類	功效	加工容易	設備低廉	省能源	大型產品	自動化
射出成型加工	264, 480, 500, 527, 549, 577		246, 301, 473	245, 300	245	7, 206, 22
擠壓成型加工	348, 496, 47, 48, 113, 219					238, 538
拉擠成型加工	12, 13, 204, 2, 554, 60, 217, 520, 55, 561, 971					152, 351, 38
真空鑄成型加工						
收絲加工	539, 579					
射出成型加工	718, 271, 282, 281, 272					
拉擠成型加工	489, 519, 555, 557, 14, 126					
真空鑄成型加工	300					
RTM						
手精法						

第二階—熱固性複合材料加工專利						
技術分類	功效	加工容易	設備低廉	省能源	大型產品	自動化
射出成型加工	長纖			133	567	519, 11, 536
擠壓加工	短纖					
拉擠加工	UD預浸材	251, 272, 218, 271, 252				
拉擠加工	預浸布					
拉擠加工	CARBON	465, 513, 557				
拉擠加工	GLASS	14, 126				
真空袋成型加工	UD預浸材	500				
真空袋成型加工	MAT					
真空袋成型加工	預浸布					
RTM	MAT					
手精法	強化布					

第三階—熱固複材模壓加工法預浸布專利					
技術分類	功效	加工容易	設備低廉	省能源	大型產品
預浸布	carbon fiber		3, 189, 233	233, 390	465, 505
	glass fiber	218			112
	kevlar fiber	271	78, 533	54, 131	
	carbon glass fiber				
	carbon kevlar fiber	252	155	155	

圖4 技術功效矩陣圖

6. 專利家族分析

透過專利家族 (Patent Family) 資料，能掌握競爭對手之全球技術布局。所謂專利家族包含兩層意義：一為某專利申請案在其他國家申請之同一案件，此集合可稱為專利家族；另一層意義為某專利申請案後續所衍生之連續案、部分連續案或分割案等亦可稱為專利家族。由於屬於同一專利家族之專利案均有高度相關性，因此同時分析特定群組內專利案件，相較於僅分析單一國家內的特定群組更具意義；再者由於專利為屬地主義，因此對於評估市場技術分布，與瞭解特定公司之潛在布局市場甚為重要。

專利家族資料可透過歐洲專利局（EPO）Espacenet專利資料庫中的INPADOC Patent Family資料取得，例如檢索專利號AT348946後，點選「INPADOC Patent Family」，則可得知AT348946號專利共有19件的Family專利，如圖5所示。

The screenshot shows the Espacenet Patent search interface. At the top, there is a navigation bar with the Espacenet logo and search options. Below this, a search path is shown: Search → Results page 1 → S1613841 (T1) → Family page 1 → AT348946 (T) → Family page 1. The main content area is titled "Family list: AT348946 (T) — 2007-01-15". It includes a sidebar with navigation options like "Bibliographic data", "Claims", and "INPADOC patent family". The main area shows 19 applications for AT348946 (T) and a table of related patents. The table has columns for Inventor, Applicant, EC, IPC, Publication info, and Priority date. Three patent entries are visible in the table, all related to thermodynamic cyclic processes.

Inventor	Applicant	EC	IPC	Publication info	Priority date
★ LENGERT JOERG (DE)	SIEMENS AG (DE)	F01K25/06B	F01K25/06 F01K25/08 F01K7/00 (*1)	AT348946 (T) 2007-01-15	2004-04-16
★ LENGERT JOERG	SIEMENS AG	F01K25/06B	F01K25/06 F01K25/08 F01K7/00	AU2005233321 (A1) 2005-10-27 AU2005233321 (B2) 2009-07-16	2004-04-16
★ LENCERT JOERG (DE)	SIEMENS AG (DE)	F01K25/06B	F01K25/06	CA2629936 (A1)	2004-04-16

圖5 Espacenet專利家族列表頁面 (AT348946)

7.法律狀態分析

專利分析中專利案件的法律狀態亦十分關鍵，

法律狀態分析之目的為取得案件訴訟紀錄、專利權維護紀錄等，可瞭解某專利案件是否已審核通過、是否有過舉發、是否有過訴訟案或尚未支付年費等事件。同時由於專利年費昂貴，若非市場上的確有此技術需要，企業絕不輕易投入資金維護，因此若某件專利極具價值，企業必投入巨額資金進行全球布局並加以維護。此外若專利案件曾遭遇訴訟，顯示該案可能引起較強勢競爭者的矚目，使對方採取訴訟進行圍堵策略，而此亦隱含該專利之技術通常較具競爭力。由於專利維護費高昂且逐期提高，若非具商業價值之專利，企業將不輕易持續投入專利維護費用，因此進行法律狀態分析時，可將各項相關法律狀態資訊，作為評估該專利是否具有競爭力之評分權重或參考依據。

8. 申請專利範圍分析

申請專利範圍分析，在技術研發階段，可進行既有專利文獻的檢索與要件解讀，以瞭解先前技術背景與其所受保護之法律範圍；在創新提案階段，對於公司內部所提專利構想書可以進行初步的可專利性評估；而在專利申請階段遇到答辯、再審查、訴願或行政訴訟時，均需透過申請專利範圍分析以

明確申覆主張的技術範圍；在專利權獲得後可能遭遇的舉發與侵權等專利攻防，則可利用申請專利範圍分析來釐清兩造技術範圍差異，保障自己的權利。申請專利範圍的解析原則可以從數量詞來拆解元件、注意從屬連接詞（之、的……）的出現、以元件標號釐清元件間關係等三個面向來解析。至於可專利性的判斷原則有新穎性、進步性與產業利用性的判斷，而侵權鑑定的判斷原則包含了全要件、均等論與禁反言三個原則。

(1) 檢索報告的使用

檢索報告在申請專利範圍分析的使用時機，為對於審查結果有疑義欲進行答辯、再審查、訴願或行政訴訟時，在臺灣可利用經濟部智慧財產局檢附之「專利申請案檢索報告」所提供的引用文獻技術內容之相關段落，與對應的申請案請求項及其關聯性代碼資訊進行申請專利範圍的分析。

目前提供專利申請案檢索報告的有臺灣、歐洲及PCT，歐洲及PCT均可在線上專利資料庫取得專利案的檢索報告，請參考本書前面專利資料庫的介紹。臺灣的專利案檢索報告，經濟部智慧財產局（2007）自2007年1月1日起，

推動在「審查意見通知函」或「核准審定書」檢附「專利申請案檢索報告」之措施，適用於中華民國發明專利及新式樣專利，並可於「專利審查公開資訊查詢系統」檢索及下載。

專利申請案檢索報告係用以記錄發明專利申請案審查，記載包含專利案基本資料、檢索技術領域及資料庫、引用文獻及比對結果等事項，藉此呈現請求項與引用文獻中關於新穎性或進步性之關聯比對紀錄（石博文，2007；中華民國經濟部智慧財產局，2008）。

經濟部智慧財產局的專利檢索報告如圖6，為審查人員將檢索取得引用文獻所揭示技術內容之相關段落處，與申請案請求項技術特徵比對後，依其關聯程度與引用文獻類型，給予【X、Y、A、D、E、O、P、L】等不同關聯性代碼。該關聯性代碼之用途與代表意義，類似於歐洲專利局關聯程度代碼（Category of Documents）及WIPO比對結果代碼（Categories Indicating Cited Documents）。然而臺灣對於專利審查所檢附「檢索報告」中所使用「關聯性代碼」之代表意義，與歐洲專利局及WIPO有些許差異，而代碼方面則無歐洲專利局的【T】與

WIPO的【&】兩個代碼。茲將關聯性代碼之意義說明如下：

- ①代碼X：單獨引用即足以否定發明新穎性或進步性之特別相關的文獻。
- ②代碼Y：結合一或多篇其他文獻後足以否定發明進步性之特別相關的文獻。
- ③代碼A：一般技術水準之參考文獻。
- ④代碼O：公開使用、販賣或展覽陳列之文件。
- ⑤代碼P：申請日與優先權日間公開之文獻。
- ⑥代碼E：申請在前、公開／公告在後之專利文獻。
- ⑦代碼D：說明書已記載之文獻。
- ⑧代碼L：其他理由引用之文獻。

附件

第 097141178 號專利申請案檢索報告

1. 申請日：97 年 10 月 27 日		
2. 優先權日：無		
3. 本案國際專利分類號(IPC)： B23D47/04 (2006.01) , B27B5/29 (2006.01) B27B27/10 (2006.01)		
4. 檢索國際專利分類號(IPC)範圍： B23D47/04 (2006.01) · B27B5/29 (2006.01) · B27B27/10 (2006.01)		
5. 檢索使用資料庫名稱(關鍵詞)： EPO, JPO, TIPO 國內外專利資料庫, USPTO		
關聯性代碼	引用文獻資料與相關段落處	相關聯請求項
A	1. US 2007/0113715A1 2007/05/24 全文	1~6
A	2. US 2007/0163408A1 2007/07/19 全文	1~6
A	3. TW M320931 2007/10/21 全文	1~6
關聯性代碼說明： X： 單獨引用即足以否定發明新穎性或進步性之特別相關的文獻。 Y： 結合一或多篇其他文獻後足以否定發明進步性之特別相關的文獻。 A： 一般技術水準之參考文獻。 D： 說明書已記載之文獻。 E： 申請書前、公開/公告在後之專利文獻。 O： 公開使用、販賣或展覽陳列之文件。 P： 申請日與優先權日間公開之文獻。 L： 其他理由引用之文獻。		

完成日：100 年 6 月 1 日

第 1 頁 / 共 1 頁

圖6 臺灣097141178號專利申請案檢索報告

(2) 新型專利技術報告的使用

臺灣新型專利自2004年7月1日起改採形式審查，並未對專利的新穎性及進步性進行實質審查，如欲進行臺灣新型專利的申請專利範圍分析，應先向經濟部智慧財產局申請該專利案的新型專利技術報告，如已有技術報告則可直接下載瀏覽，透過技術報告所揭露的比對結果及比對結果代碼，作為國內新型專利進行申請專利範圍分析的根據。

臺灣新型專利技術報告之項目如下圖7，其中「先前技術資料範圍」係審查人員搜尋國內外專利文獻及刊物之紀錄，提供各請求項「比對結果」之佐證（黃文儀，2004）。

新型專利技術報告

- 1、**新型專利證書號數**：M271132
- 2、**申請案號**：093221148 e01
- 3、**申請日**：2004年12月29日
- 4、**優先權日**：
- 5、**技術報告申請日**：2008年4月28日
- 6、**新型名稱**：負焦型反射式燈具之結構
- 7、**新型專利權人**：
名稱：財團法人工業技術研究院
地址：新竹縣竹東鎮中興路4段195號
- 8、**專利代理人**：
- 9、**新型專利技術報告申請人**：財團法人工業技術研究院
- 10、**完成日**：2008年9月19日
- 11、**審查人員姓名**：張耀文 委員
- 12、**國際專利分類**：IPC(1-7) F21V 3/00
- 13、**先前技術資料範圍**：
 - a. 國內專利文獻
國際專利分類：IPC(1~7) F21V3/00
F21V 3/00 (2006.01)
期間：~2008年9月18日
 - b. 國外專利文獻
國際專利分類：IPC(1~7) F21V3/00
F21V 3/00 (2006.01)
期間：~2004年12月28日
 - c. 刊物：
 - d. 其他：
- 14、**比對結果**：
引用文獻一覽表：
 1. 1998年11月21日公告（中華民國專利公告第346175號）。
 2. 1999年2月1日公告（中華民國專利公告第352165號）。
請求項 1~14
比對結果代碼：6
引用文獻：1及2(一般技術水準之參考文獻)



以下為各請求項比對結果代碼之意義：(左邊數字為代碼，其後文字為該代碼意義說明)

代碼1：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無新穎性。(專利法第94條第1項第1款、第2款)

代碼2：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無進步性。(專利法第94條第4項)

代碼3：本請求項的創作，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同。(專利法第95條)

代碼4：本請求項的創作，與申請日前提出申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第1項、第4項)

代碼5：本請求項的創作，與同日申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第2項、第4項)

代碼6：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。(包括說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況)

本技術報告關於請求項之比對結果，僅供參考。

1 5、**備註：**

本新型專利技術報告係依2005年5月24日修正之公告本進行比對。

1 6、**注意事項：**

專利法第104條規定「新型專利權人行使專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」

專利法第105條規定「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」

圖7 中華民國M271132號新型專利技術報告